

2008年5月30日(金) ~ 30日(金)

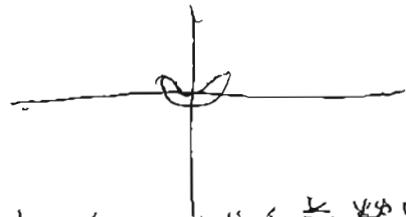
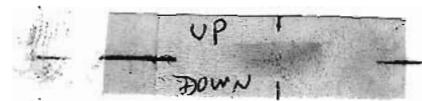
PP 中尾
名工大井田・東工大豊田

三引 - 水平調整前

MFH 0014498 (CH6)

MRH 0020530 (CH7)

PM16C-02N
PULSE MOTOR CONTROLLER



1才2千2211"手前盤生板レフ-2"

接

元170. 37-

		THE	min max	Para
0.0	25.0			
-5.0	50.0		DTH	
-5.0	5.0		PH2	
-25.0	25.0		D1	
-10.0	35.0		MFV	
-10.0	35.0		MRV	
-7.5	7.5		MFH	
-7.5	10.5		MRH	
-25.0	25.0		BNT	
36000.0	/deg.		TEM	
20000.0	/m		Z2	
2000.0	/deg.		AZM2	
20000.0	/m		Z1	
5000.0	/m		MFV	
-5000.0	/m		MRV	
2000.0	/m		MFH	
2000.0	/m		MRH	
8000.0			BNT	
0.0		THE	zero point	
0.0			DTH	
0.0			PH2	
0.0			D1	
0.0			MFV	
0.0			MRV	
0.0			MFH	
0.0			MRH	
0.0			BNT	

Value → Pulse

DT2調整後

par

(10.995 12.734, 0.266, 0.0)

(29.404 31.533 7.249 1.265)

0.00

○ 4 Bi の切り換え (半導体) (記録・冊子)

16 CHANNEL PULSE MOTOR CONTROLLER

"PM16C-02N" の構成は 前回の Bi 使用時
(半導体) の通り複数のモーターを同時に制御する.
やや複雑だが.

TEM と CCW が二つの電源. CW 方向と反対.
SOP で Y=1 と X=1 と Z=1 を組み合わせ.

~~Y=1~~ と ~~X=1~~ と ~~Z=1~~ と用意する
Y=1 と CW, CCW が二つのモーター
を制御する. TEM 駆動部の

Y=1 と X=1 は 「常時通電」, Y=1 と Z=1 は
「常時切斷」を意味する.

若林氏の PM-210-3 機構は -Y=1 は
「常時切斷」, Y=1 は 「常時通電」を設定する.

CCW 侧は Y=1 と脱出.

「常時通電」, Y=1 と Z=1 は 設定しない.

CW 侧は Y=1 と X=1, CCW 侧は Y=1 と
Z=1 の配線を入出力端子に接続する.

電源は 24V と 12V である. 24V は
電圧を 12V に下げる.

何故かの原因は ~~電源回路~~ は常時接続

で、24V が不明.

片田	MFV	0147018	-26.99	片田	MFV	0147018	-28.9-
(100V)	MRM	0157667	-31.48	(100V)	MRM	-0157667	-31.4-
2.	MFH	0014498	7.18	&	MFH	0014498	7.3-
木下	MRH	0020530	10. 34	木下	MRH	0020530	10.3-
				E=7			-3.1

また、「ガス2ト→11°」の操作手順が
不明で、それを4B₂モードに入れて操作する。

○ PM16C-02N の 11° ループ故。 \Rightarrow

~~手動~~ 手動 12 タイム 17 日、ミラー調整 (by 沢田) 後

CH	軸名	11° ループ値	ボクシングモード値	DM3C-01 π0シミュレーション値
9	TEM	-0395809	-28.84	
1	Z2	0254675	-31.48	
2	DTM2	0010002	-23.9	
3	Z2	0000000	+0.34	
4	MFV	014X018	-28.84	
5	MRV	-015X667	-31.48	81 19.92
6	MPH	0014X18	7.39	±0.1 12.62
7	MRH	00200310	10.34	AZMO, 13.97
8	BNT	0000000	0.10	

1+1+1 > 傾斜



機械満足度

ガスマスターの緑点灯

① ガスマスター (10% IN 状態) は、ミラー高さ (MFV, MRV) の CCW 方向へ。
(緑点灯)

踏みこづれ = 8

and

② モードとミラーの間の手動式ストップのセンサ上部側面に接触

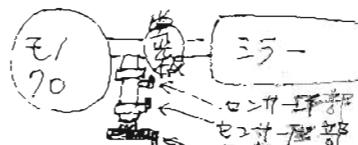
13 = 8

③ モード手動 = 8

モードとタクの緑点灯

BL-4B1 後端尖板

182 の位置



○ MAS の調整.

$P = 23 \text{ kN} \times \frac{4\sqrt{3}}{3} (T_2 + T_1, \theta = 78^\circ)$.

- No. 6 HV ~~調整~~ 調整

e^- SS~~速~~ 870 V.

- $\gamma \rightarrow f^+ \pi^- \rightarrow \pi^+ \pi^-$

e^- SS~~速~~: -8.05 mm (\leftarrow ^(前回) -7.90 mm)

- $\pi^+ \pi^- \pi^+ \pi^-$

e^- SS~~速~~: -10.3765 mm
(FWHM 0.0456 mm)

- $\pi^+ \pi^- \pi^+ \pi^-$ 自動切替

No.	$\Theta A (^\circ)$	$\Delta \Theta_{\text{正}} (^\circ)$	$\Delta \Theta_{\text{反}} (^\circ)$
1	10.636	124.8460	124.8484
2	10.562	99.8220	99.8223
3	10.529	84.8154	84.8144
4	10.946	49.8154	49.8127
5	10.753	24.8375	24.8339
6	10.584	-0.0134	-0.0138

- Θ 調整

補正値 0.995°

2008年5月31日(火)

○ 操業S: 特殊 SRM670C 測定の許可(附録付)

MS Windows の自動更新や設定を行なった。

夜3:00にコントローラに再起動をかけ、 T_1 , T_2 ,

測定モードをループ状態に。

自動文字と無線にて設定を行なった。

土曜に測定制御プログラムにて、カウントの値を

10回読み込みました。Igor Experiment

ツールを用いて保存しておいたのは上記とおり。

(1回モードは約0.3秒程度、 $T = T = \infty$)

約1MBのツールで

○ 操業S: 特殊 測定

No. 6 検出器 111~555 反応合計 19本

No. 5 ~ No. 1 検出器 111 反応

左 平板回転試料台無回転、 $\theta = 0^\circ$ 位置、

90° 位置 2 回転

入射角 8° 、反射角 ~~W10xH1 mm²~~ $W10 \times H1 \text{ mm}^2$

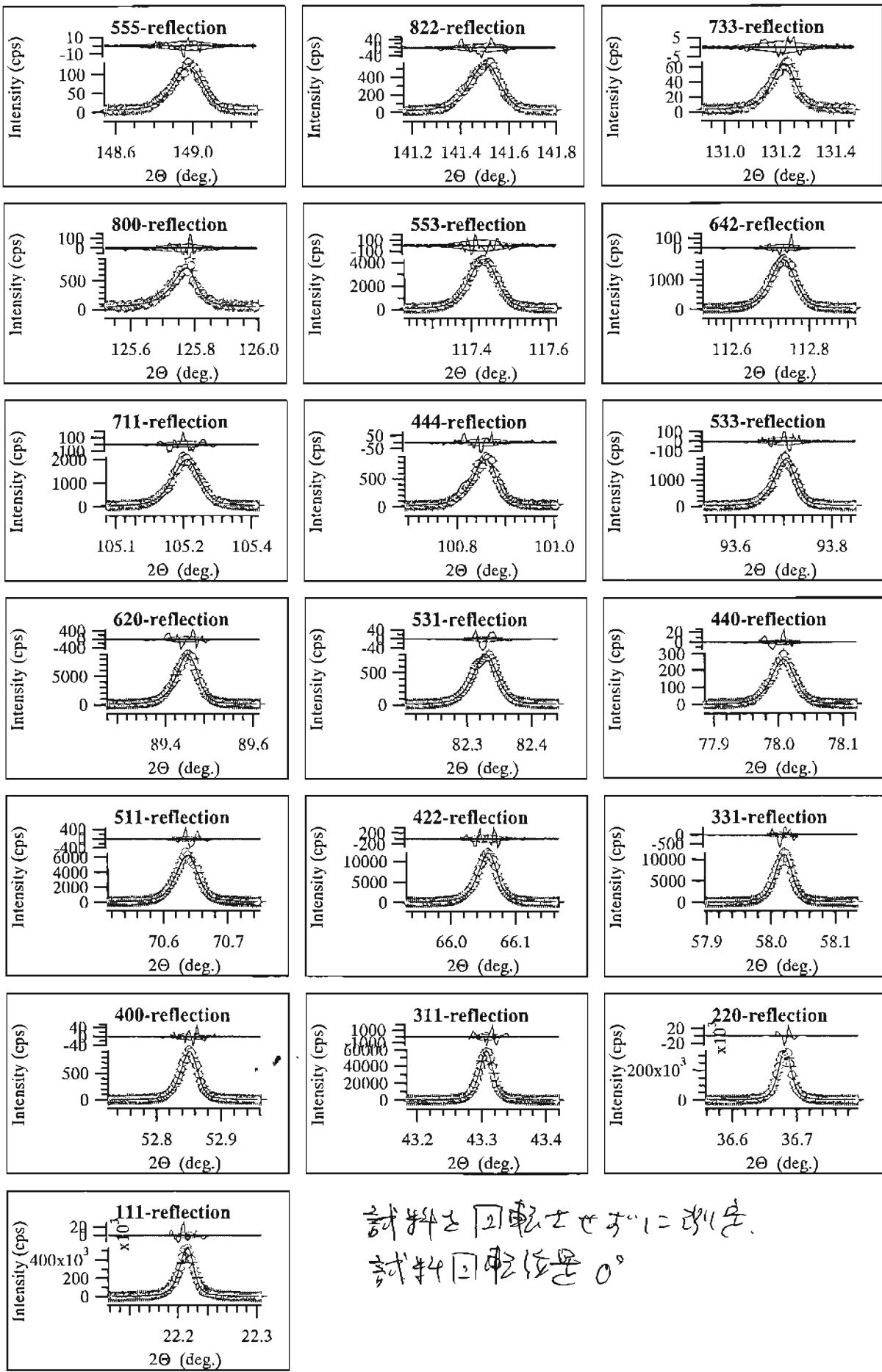
直径 5 cm オーバー 2.5 cm の条件

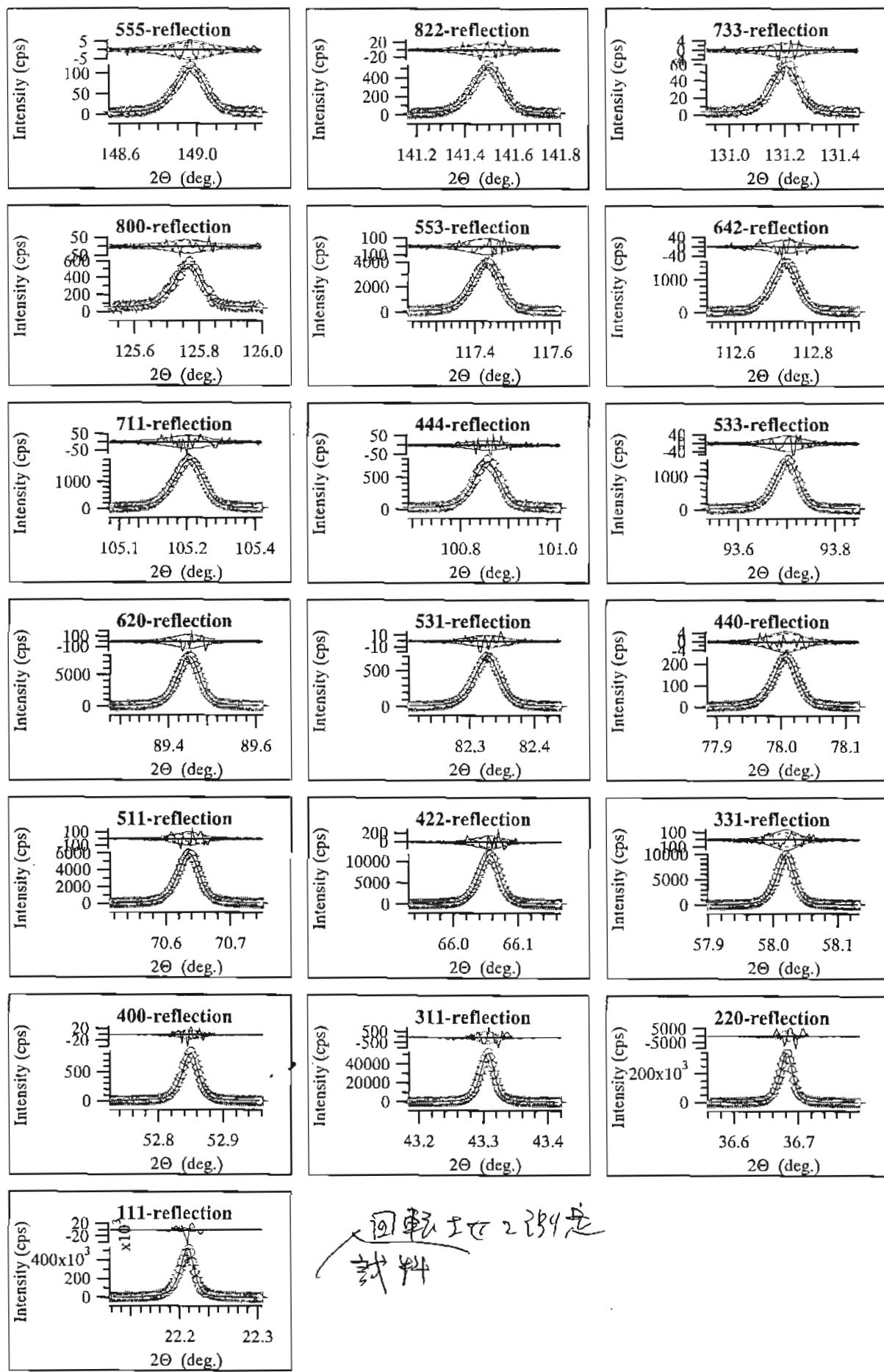
測定 \Rightarrow "MAS20080531-1.pxp"

同条件 平板回転試料台回転 ($360^\circ / 0.5s$)

左回転 測定 \Rightarrow "MAS20080531-2.pxp"

最短(单行) FT = 0.5s





○ 標準 S_i (NIST SRM 640c) 回転せざる測定.

再測定. \Rightarrow "MAS20080531-3.pxp"

(0°位置と90°位置) 2wave干涉法による測定

3回目測定 \Rightarrow "MAS20080531-4.pxp"

○ 標準 S_i (NIST SRM 640c) 回転せざる測定. (2回目)

$\underbrace{PT = 1s}$ 測定 \Rightarrow "MAS20080531-5.pxp"

単位

○ 標準 S_i (NIST SRM 640c) 回転せざる測定.

~~90°位置~~ \Rightarrow "MAS20080531-6.pxp"

(初期位置(山と谷))

○ 標準 S_i (NIST SRM 640c) 回転せざる測定.

再現性評価における誤差の内訳

単位 PT = 2s, ~~測定時間~~

初期位置 0°位置, 回転角±度±分

試料回転

2回測定.

測定開始 23:46 \Rightarrow "MAS20080531-7.pxp"

回転せざる測定 (左子) \rightarrow (MAS20080531-5) + 3

右子 \rightarrow 游標 \neq 基準 \rightarrow - 1.1

$$\lambda = 1.208592(5) \text{ Å}$$

$$2\theta_1 + \Delta \text{ 誤差 } \Delta 2\theta_0 = -0.0140(7)^\circ$$

$$2\theta_1 \text{ 倍心率 } \Delta 2\theta_1 = 0.0080(6)^\circ$$

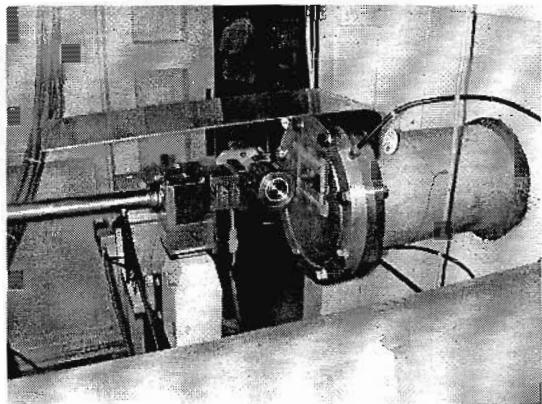
$$2\theta_2 \text{ 倍心率 } \Delta 2\theta_2 = 30.8(1.3)^\circ$$

2°左, 右.

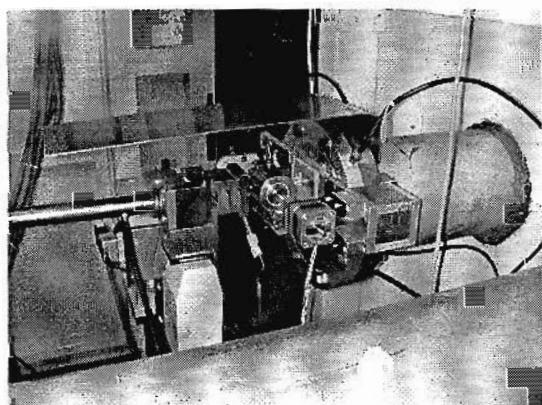
2008年6月1日(日)

○ 滑音器自動挿入器の設置

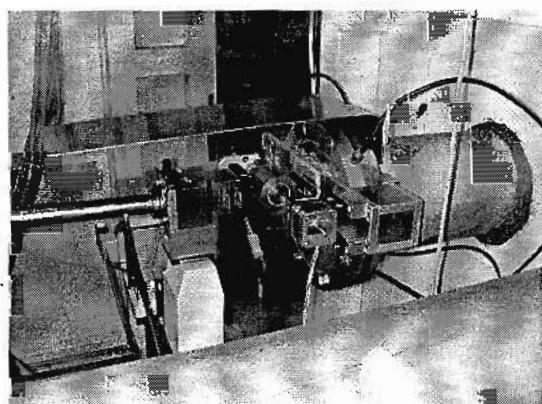
2008年6年1日(日) 名古屋工業大学 井田



Chipman mechanism 設置前 (4/25/2008 井田
写真)



Chipman mechanism 設置後、AI 非挿入時



Chipman mechanism 設置後、AI 挿入時

検出率の数々落とし
特性を定期的
お子様随時
評価お子ために
AI端を挿入する
自らの手
アシストメニを
常設する。

○ 粒子統計評価. 予備調査 (NIST SRM640c)

予備実験 \Rightarrow "MAS20080601-1.pxp"

○ 粒子統計評価. 入射角依存性調査 \Rightarrow "MAS20080601-2"

動吸収係数の影響をより受けろ

$\alpha = 3.654^\circ, 9.654^\circ, 11.654^\circ, 13.654^\circ, 15.654^\circ$

$t^- \rightarrow$ 位置は工場で固定し, ($2\theta = 43.308^\circ$)

試料面内回転角を $1^\circ, +5^\circ, +2^\circ, -360^\circ, +2^\circ$

変化角度測定をより早く, $T_2 = 18$

以下の入射線射角を用いる (アーチャン)

$\alpha = 3.654^\circ, 9.654^\circ, 11.654^\circ, 13.654^\circ, 15.654^\circ$

~~17.654°, 21.654°, 23.654°, 25.654°, 27.654°~~

$17.654^\circ, 19.654^\circ, 21.654^\circ, 23.654^\circ, 25.654^\circ,$

$27.654^\circ, 29.654^\circ, 31.654^\circ, 33.654^\circ, 35.654^\circ,$

$37.654^\circ, 39.654^\circ, 41.654^\circ,$

$t^- \rightarrow$ のばりをもつ. 各回転角ごとに条件を

以下の 試験粒の数は 400 ~ 250 回と

見積もる. この入射角依存性は照射体積

$$V_{irad} = W \times \frac{H}{sin\alpha} \times \frac{1}{\mu} \left(\frac{1}{sin\alpha} + \frac{1}{sin(2\theta-\alpha)} \right)^{-1}$$

W: t^- の幅

H: t^- の高さ

μ : 錫吸収係数

の変化と直角に一致する。

予測: ~~測定~~ $12\mu\text{m} \times 18\text{mm}$ の A 人造 γ 放射線成像 12 時間以内

○ 平板回転試験台の初期の調査 \Rightarrow "MDS20080601-3"

入射角依存性調査と同様

試料を面内2(±回転/s)上で走行

測定方法以外は粒子統計の入射角依存性

調査と同様の測定を t_1, t_2 .

t_2 を t_1 より $1^{\circ}, +2^{\circ}$ で $\alpha = 27.654^{\circ}$ 測定

$\alpha = 18^{\circ} 21' T_2 \alpha 2^{\circ}$, 2度走行後 t_2 と t_1 .

○ 数字落とし特性調査

便宜上、平板回転試験台 $\approx 1=t_1, t_2=9-$

$2^{\circ} 5^{\circ}$ と t_2 の α と t_2 の α を記述

試みに

自動減速器(2) $12\mu m$ 厚 Al箔 16枚

と t_2 と t_1 , $18^{\circ} 21'$ で t_2 と t_1 の α を $2^{\circ} 5^{\circ}$

~~固定減速器~~ Cu5(2)

$18^{\circ} 21' W2.5 \times H1.0$

~~10m/s + 3m/s 20m/s + 6m/s + 3m/s + 2m/s~~
~~+ 6m/s + 3m/s + 2.4°~~

$1.6^{\circ} 12.8^{\circ} 18^{\circ} L -1^{\circ} \sim 1^{\circ}$ の範囲と $2^{\circ} 5^{\circ} 2^{\circ} 1^{\circ}$

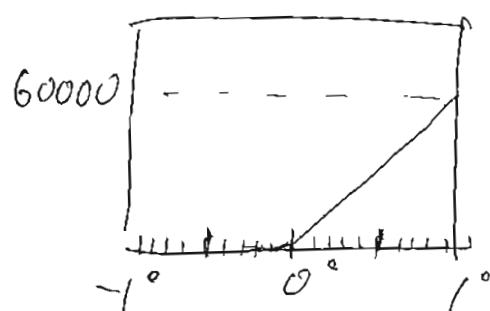
計測時間

0.5s

右図の t_2 と t_1 .

$18^{\circ} 21' 0.25 s$

何が2~3?



$-0.8^{\circ} \sim 0.8^{\circ}$ の範囲を $2^{\circ} 5^{\circ} 2^{\circ} 1^{\circ}$ と
当面 $t_2 < 17^{\circ}$ を小分け.

24:36 高さ 12cm の 1mm^3 の 0.5mm の θ を 12° にする。

$\theta = \tan^{-1} \frac{1}{12}$

今 $\theta = 12^\circ$ である。

$\theta = \tan^{-1} \frac{1}{12} \approx 5^\circ$

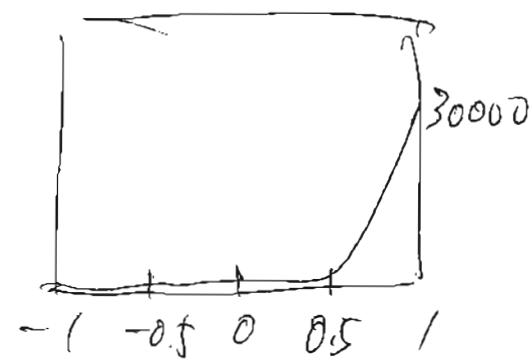
つまり

アーチ correction off 12°

アーチ correction off 5° , 20° .

アーチ correction off 0° 。

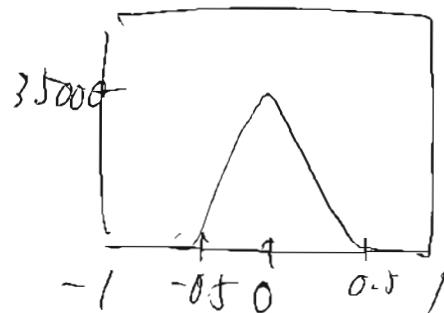
アーチ correction off 12° .



自動減速器をアーチ

用いてアーチ correction

(ccw(50) & l +)

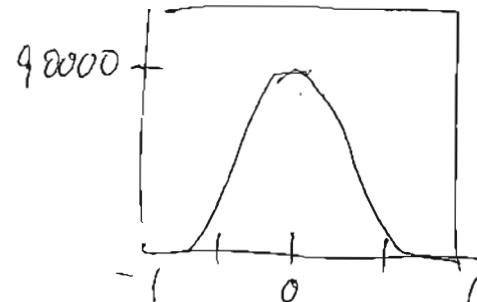


-0.6° \rightarrow 0.1° のアーチ

アーチ correction が実現される。

ccw(50) 2°減速器と直角アーチ。

2度減速器と初期状態とある。



Chipman 法 12月3日は \Rightarrow "MDS20080601-4.pxp"
 実験条件: $T_1 = 20^\circ\text{C}$, $T_2 = 25^\circ\text{C}$
 解析方法: T₂ (中性点滴起始時間) で χ^2
 抗強度 $\rho = 1$ と固定 (T₂)

検出器番号	12μm × 16 Å 透過率	死時 (μs)
6	0.2768(4) 0.2727(8)	1.061(7) 1.47(2)
5	0.2739(12)	0.96(32)
4	0.2742(7)	1.45(1)
3	0.2769(6)	1.60(1)
2	0.2741(6)	1.57(1)
1	0.2730(6)	0.99(1)

No.5a 死時の測定精度の結果、誤差が大きい。

比較的死時間が短い (数ミリ秒 (12c13))

a2 通常の使用では問題ないと思われる。

(以前の ~~±~~ No.5a の
死時間 $1.258(4)$, $1.084(4)$, 抗強度 $0.846(6)$, $0.704(27)$ T₁, T₂)

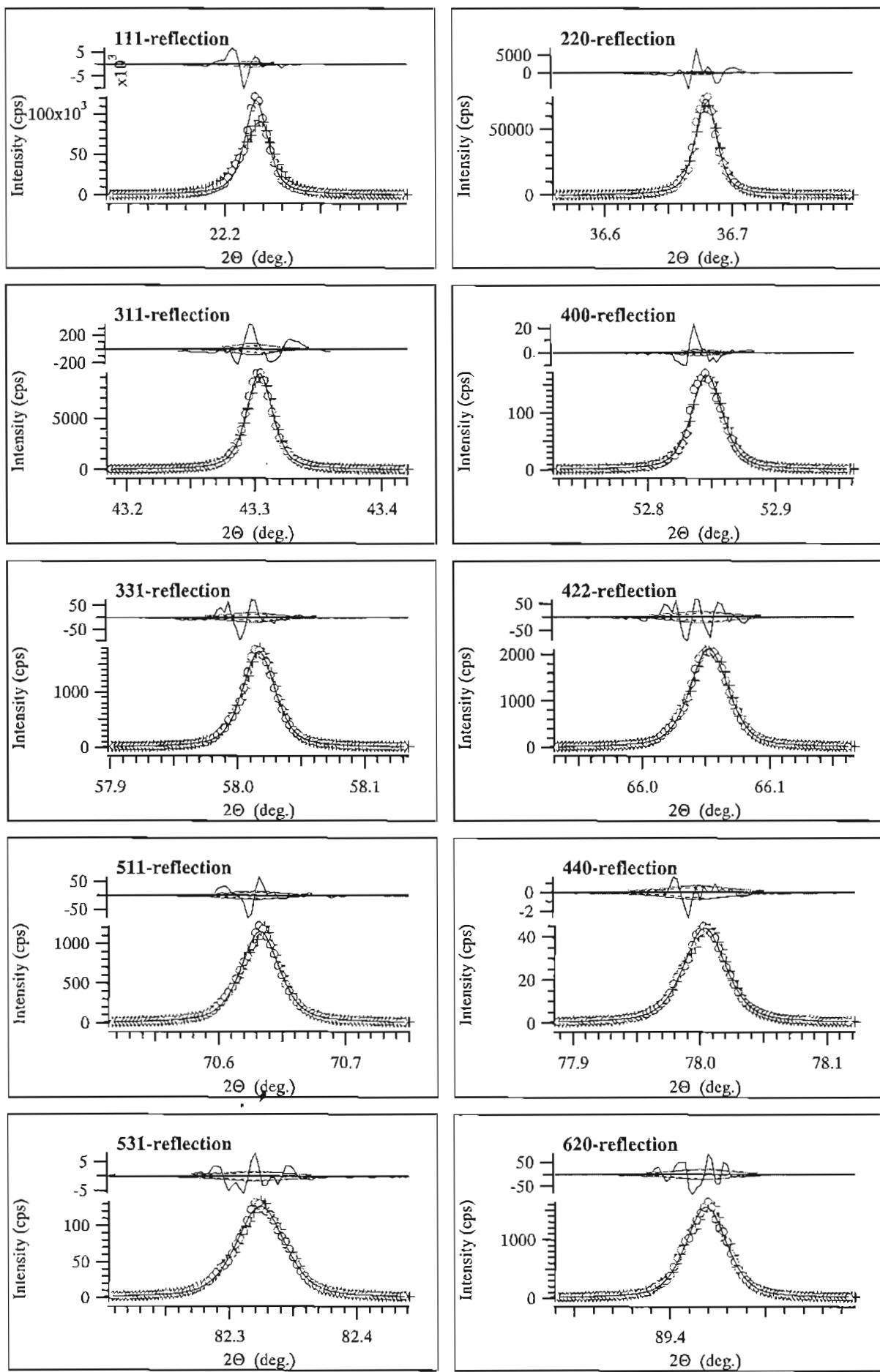
2011年 - 5月 游星轉正をやり直す
(ref. p. 67)

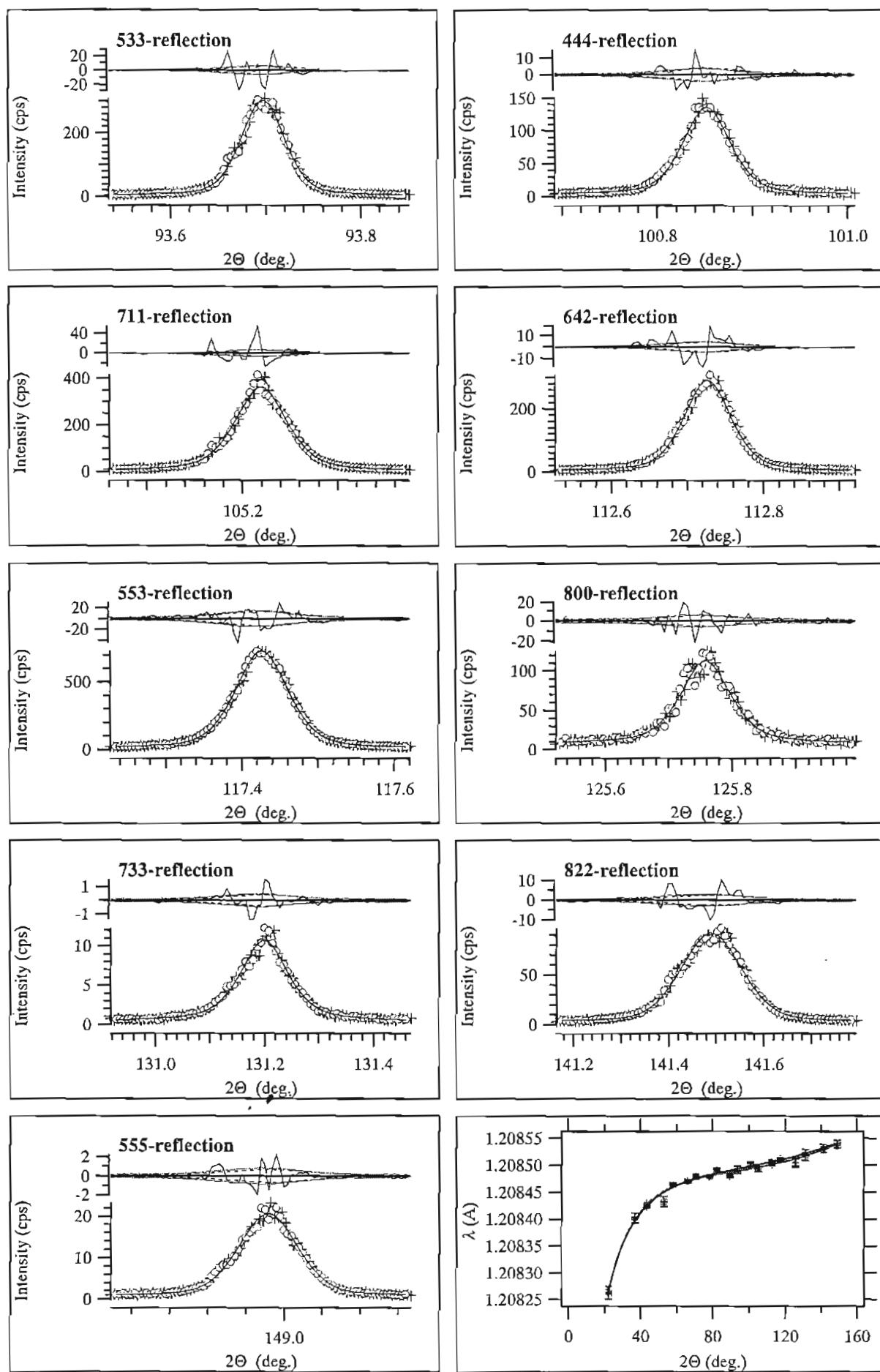
$$\lambda = 1.208585(13)\text{\AA}$$

$$\Delta 2\theta_0 = -0.0119(21)^\circ$$

$$\Delta 2\theta_1 = 0.0061(18)^\circ$$

$$2\theta_2 = 30(5)^\circ$$





申込事項

分光器光学系

モードは3-0制御用、2.1.T= PC-9801FA用

11-ドス2S PC-HD100用 走査用と合わせて。 (#10-p.172)

コントローラ (Tsuji Aoshi PM16C-02N) は

操作用(F-波長変更や調整用)とモニタ用

で構成され、今朝は原叫波長 1.2 Å で

固定して測定を実施する。

~~コントローラ~~

CH	条件	1.0m波数	走査範囲
0	TEM	-03958.9	-
1	Z2	02546.75	
2	DTM2	0010022	
3	Z1	00000000	
4	MPV	0147018	-28.82
5	MRV	-015766.7	-31.48
6	MPH	0014718	7.39
7	MRH	0029310	10.34
8	BNT	00000000	0.10

スリット幅 H / 2^a t = 7.39 μm

1.208585(13) Å

(標準 S: NIST SPM640c) 2^a 調整

解説用 (F11.3) + → ⇒ "Connect 080602-0.pxp"

~~計~~ 実験 11-4 内. 自動減衰器設置

入射 γ -線 $E = 12$, Chipman の直接方法 $E = 5\gamma$
検出系の数と落とし特性を評価する際 12
使用する \times カニスルを設置し $E = 12$. (cf p. 68)

AC 100V 電源端子から主出力 $E = 2 \times 302$

通常はコマセ 2 が抜かれて、使用する主電

電源を接続します。12mm 厚の Al フィルムを

5 枚 2 枚 \times 1. 2 \AA 設定時の強度を

約 1/4 に落とす $= 2 \times 2 \times 3$. (cf p. 72)

制御 γ -線 $E = 12$, CW(50) と 2 反時計回り 12

γ -線 $E = 12$, CW(50) と 1 反時計回り 12

90° 回転, CW(50) と 1 反時計回り 12

反時計回り $= 90^\circ$ 回転します。

回転計

試料台: 半径回転試料台

試料 $3 \times 3 \text{ mm}^2$: $3 \times 2 \text{ Ge}(111)$

光路 103 cm

Slit base 距離 -8.05 mm

Gonio base -10.3865 mm

No.	$3 + 3 \times 4^\circ$ 前(0) $\pm 0^\circ$ 前(0) $\pm 0^\circ$ 後(0) $\pm 0^\circ$	124.8460	124.8484
1	10.636	124.8460	124.8484
2	10.562	99.8220	99.8223
3	10.529	74.8154	74.8144
4	10.946	49.8154	49.8127
5	10.753	24.8375	24.8339
6	10.584	-0.0134	-0.0138

① 勧誘正位 0.945°

(壊れ2月7日 #10)
(修正してます)